日刊工業新聞
年月日 26 10 30 ページ 第2部 09 NO.

コフロック社長　小島 望氏

需要変動に耐える基盤構築



―事業環境をどう見ていますか。

「当社は流体制御機器とガス発生装置を手がけるメーカー。２０２５年末から、半導体業界向けでマスフローコントローラー（ＭＦＣ）と渦式液体用流量計の引き合いが活発だ。５年前から半導体業界向けのモノづくりを強化し、成果が出てきた。ガス発生装置もガスボンベの代替などでコストメリットを感じてもらい、好調だ。今期（27年３月期）は過去最高の売上高、営業利益も過去最高水準を見込む」

―海外事業も強化しています。

「海外売上高比率は25％あり、その半分は中国。分析装置向け比例電磁弁などを日本から部品供給し現地生産を行っている。同国の国産化政策の流れもあり、引き合いが強い。１年前には韓国で合弁会社を作り、半導体関連製品の販売を始めたが、現地生産も検討する。海外比率は35％以上にしていきたい」

―４月から中期経営計画が始動しました。

「今後３カ年で稼ぐ力をつけ、営業利益率10％水準を目指す。半導体関連などで需要変動に耐えうる生産基盤の構築を図る。（買収した）エムテックとのシナジーを発揮し、半導体以外の医療や環境分野も攻めていく」

―〝ほんまもん〟の製品をあげてください。

「流量計測の技術を最大限に生かし、22年１月に製品化した『温度補正付液体用渦流量計』をあげたい。業界で初めて内部にセンサーを組み込み温度補正ができるのが特徴だ。省スペース化も図れ、半導体製造装置メーカーに採用された。今後の伸びが期待できる」

無断転載・複写禁止㈱日刊工業新聞社